

22.09.2017 MKM 2017 w Częstochowie

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Pracownicy GUM wystąpili z referatami podczas XLIX Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów 2017



Pracownik Zakładu Metrologii Interdyscyplinarnej Dariusz Luśtyk podczas wykładu

Dyrektor Generalny Urzędu Andrzej Hantz

Metrologia rozumiana jako nauka i technika poznawania otaczającego nas świata materialnego za pośrednictwem metod i przyrządów pomiarowych była tematem wiodącym XLIX Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów 2017, która odbyła się w Częstochowie i Koszęcinie w dn. 4-6 września br. W cyklicznej konferencji, organizowanej przez Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej, uczestniczyli naukowcy reprezentujący różne dziedziny i dyscypliny nauki, a także przedstawiciele Głównego Urzędu Miar, z dyrektorem generalnym Urzędu, p. Andrzejem Hantzem.

Pracownicy GUM zaprezentowali następujące referaty:

- Dariusz Luśtyk, Michał Mosiądz, Marta Wierzejska-Adamowicz - Automatyzacja badań zaburzeń napięcia zasilającego taksometrów,
- Michał Siarkiewicz - Prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych,
- Katarzyna Nicińska, Joanna Przybylska - Najnowsze kierunki rozwoju metrologii kąta płaskiego,
- Jerzy Szutkowski - Kalibracja miernika fazy z odniesieniem wyniku pomiaru do państwowego wzorca jednostki miary kąta płaskiego.

Jednym z uczestników konferencji był też pracownik Obwodowego Urzędu Miar w Białymstoku p. Robert Pogorzelski, który przedstawił wykład pt.: "Szacowanie niepewności pomiaru natężenia oświetlenia metodą analityczną oraz Monte Carlo".

Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego MKM'2017 prof. Sławomira Grysia z Politechniki Częstochowskiej. Autorem zdjęć jest p. Paweł Zaremba.